赤外吸収分光法による多結晶シリコン中の 酸素および炭素濃度の定量測定

機械·材料技術部 小 野 春 彦

明治大学理工学部 石 塚 貴 英

小椋厚志

フーリエ変換赤外分光法を用いて、太陽電池用多結晶シリコン中の格子間酸素および置換型炭素を定量測定する技術を検討した。単結晶シリコンで確立している JEIDA 標準測定法を検証し、単結晶とは異なる多結晶特有の問題を明らかにした。多重反射の効果は不純物濃度が低いほど、また試料が薄いほど強く、このため多結晶測定のように薄い試料を用いる場合には、炭素においても酸素と同様に、多重反射の補正をする必要があることがわかった。

キーワード:太陽電池、シリコン、多結晶、軽元素、酸素、炭素、濃度、赤外吸収

1 はじめに

石油燃料の枯渇や地球環境問題への懸念から,無尽蔵の 太陽エネルギーを利用した太陽光発電(太陽電池)への期 待が高まっている。なかでも,多結晶シリコンを主流とし たシリコン系太陽電池が世界の生産量の実に82%(2008 年度)を占めている¹⁾。家庭用電力供給のための分散電源 として,住宅用の多結晶シリコン太陽電池の需要は今後も 一層拡大するものと予想されるが,一般家庭への普及には さらなるコスト低減が必要である。

実際,材料・装置・プロセスの簡素化によるコスト低減 への努力がなされているが,このような技術の簡素化は, ともすれば結晶欠陥²⁾ や不純物³⁾の混入をもたらし,変 換効率を落としてしまう^{4,5)}。すなわち,コストと変換効 率の両立が課題であり,多結晶シリコン中の結晶欠陥や不 純物の理解・制御を目的とした基礎研究の積み上げが重要 である。シリコン結晶中の結晶欠陥や不純物については, 古くから研究が行われてきた。しかし,ULSI グレードの単 結晶シリコン基板が早い時期に無転位化・高純度化された ために,それらの挙動は必ずしも明らかになってはいない。

我々は、多結晶シリコン中の軽元素に着目している。太 陽電池用多結晶シリコンは主にキャスト法により作られる が、低コスト化プロセスにより、酸素、炭素、窒素などの 軽元素が大量に混入する⁶¹⁰⁾。これらの挙動を明らかにす るためには、その濃度を定量測定することが重要である。

本研究報告は、フーリエ変換赤外分光法(FTIR:Fourier Transform Infrared Spectroscopy)を用いた軽元素濃度定量 法に関する。特に、格子間酸素および置換型炭素について、 単結晶シリコンで確立している JEIDA 標準測定法を検証 し、多結晶シリコンの測定に適用する際の、単結晶とは異 なる多結晶特有の問題を明らかにした。

2 実験方法

JEIDA 標準測定法を検証するために,格子間酸素測定 用 JEIDA 標準試料を用いた。これらは,酸素濃度が大き い方からH $[10 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3]$, M $[8.9 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3]$, L $[6.2 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3]$ の3種類の CZ-Si 結晶と,参照用 の FZ-Si 結晶で,厚さはいずれも 2.00 mm である。

実試料の例として、市販の単結晶 Si 基板,ならびに Si インゴットから切り出した単結晶試料の測定を行った。

測定は、フーリエ変換赤外分光装置(Bruker IFS-113v) を用い、分解能2または4 cm⁻¹ で測定した。ビームスプ リッターは Ge/KBr、検出器はDTGS(比較のため MCT)、 光源はグローバーランプを用いた。積算回数は400回を基 本とした。

測定の手順ならびに取得したデータの解析は, JEIDA の資料^{11,12)}を参考にした。

3 結果および考察

3. 1 JEIDA 標準測定法

Si 結晶中の格子間酸素および置換型炭素による赤外吸 収は、それぞれ 1107 cm⁻¹と 605 cm⁻¹に顕著なピークとし て検出される。JEIDA ((社)日本電子工業振興協会) はラ ウンドロビン測定により、LSI 用単結晶シリコン基板中の 酸素、および炭素濃度の測定法を標準化した^{11,12)}。ここに は、シリコン結晶中の格子間酸素原子および置換型炭素原 子の濃度を赤外吸収法によって決定する際の標準測定法、 ならびに吸収係数と各原子濃度との間の換算係数が規定さ れている。表1に測定条件の一部を示す。

以下に,多重反射を考慮した JEIDA 標準酸素濃度測定 法の概要を記載する。図1は FTIR により測定した酸素ピ ーク(1107 cm⁻¹)付近の透過率差スペクトルである。まず, 透過率のスペクトルにおいて 1040, 1160 cm⁻¹ を直線で結 びベースラインとする。次に,吸収ピークの最低透過率を ピーク値(Tp)とし,そのピーク値と同じ波数のベース ライン上の透過率をベース値(Tb)とし,これら2つの 値を用い以下の方法で酸素濃度を求める。

通常、赤外吸収から不純物等の濃度を求める場合には、 Lambert-Beerの法則(1)式が用いられる。すなわち、透 過率 T から吸収係数 α を求めてこれに換算係数をかける ことにより、厚さx cmの試料中の不純物濃度を求める。

$$\boldsymbol{\alpha} = -\frac{1}{\mathbf{x}} \ln \mathbf{T} \qquad \qquad (1)$$

しかし、シリコン中の酸素濃度を求める場合、多重反射 の効果を無視することができない。JEIDA 標準測定では、 多重反射を考慮した(2)式を用いて、透過率Tから吸収 係数αを求めることが規定されている。

ただし, R は反射率(400~2000 cm⁻¹ で, Si の反射率は 0.300)、 α_L はシリコン格子振動による吸収係数(1107 cm⁻¹ 付近で、 α_L =0.85 cm⁻¹)である。

JEIDA に従えば、まず(2) 式により、透過率のピー ク値Tpからピーク吸収係数 α pを、透過率のベース値Tb からベース吸収係数 α b をそれぞれ求める。次に、格子間 酸素の吸収係数を α o= α p— α b として、これに換算係数 K を掛け次式から格子間酸素濃度の実測値を求める。

 $[Oi] (atoms/cm³) = K \times \alpha o \qquad (3)$

換算係数 K は格子間酸素の場合,JEIDA のラウンドロ ビン測定により、 3.14×10^{17} cm⁻² と定められた(IOC-88 と 呼ばれる)¹¹。ただし、この換算係数の値は多重反射を考 慮した補正を行った場合のみ有効であることに注意すべき である。炭素の場合は多重反射の補正をする必要はない (この点については後述する)ので、(2)式の代わりに (1)式を用いればよい。置換型炭素の換算係数は 8.2× 10¹⁶ cm⁻² である¹²。

3. 2 JEIDA 標準試料の測定

次に、上述の標準測定法に従い、JEIDAから配布された格子間酸素標準試料を測定した結果について述べる。特にDTGS検出器で多重反射を考慮した場合と、しない場合とについて、各標準試料の酸素濃度表示値と比較した(表2)。なお、MCT検出器の結果については後述する。

多重反射の補正を行った測定値は、各試料の表示値とか なり良い精度で一致することがわかる。これに対し、多重 反射の効果を補正しない場合、いずれの試料においても、

表1	標準測定法の条件	(抜粋) ^{11,12)}
	格子間酸素	置換型炭素
測定試料厚	$0.4~\sim 4~mm$	2 mm
	(推奨2mm)	
多重反射	考慮する	考慮しない
測定分解能	4 cm^{-1}	2 cm ⁻¹
換算係数	3.14 E17	8.2 E16



図1 JEIDA 規格による酸素濃度標準測定法

表 2 JEIDA 標準試料の酸素濃度測定値 (単位は 1E17 atoms/cm³)

		()		
試料	表示值	補正後	補正無し	MCT
L	6.2	6.3	6.9	7.0
М	8.9	8.7	9.3	9.5
Н	10	10.4	11.1	11.5

表示値より酸素濃度が大きな値となっている。これは,多 重反射によって入射光が結晶内部を往復することにより実 効的な試料厚さが大きくなり,酸素濃度を過大評価してし まうことによるものである。

3.3 多結晶ならではの測定上の問題点

JEIDA 規格の標準測定法により,厚さ2mmの標準試料 を用いれば,信頼性の高い測定結果が得られることがわかった。しかし,多結晶シリコンの場合,単結晶との違いは 結晶粒の存在である。つまり,多結晶の評価においては, 粒径数~数+mmの結晶粒構造に対応した不純物のミク ロな分布を調べたい。そのために,①薄い試料で測定した い,②顕微赤外法を用いたい,という要求がある。

まず、①について検討を行った。赤外吸収の透過測定で は、試料の厚さ方向の情報が積分されるので、JEIDA標 準測定で規定されているような2mm厚の試料では、2mm より小さな結晶粒との対応が不可能となる。このため、で きるだけ薄い試料で測定を行うことになる。このことが定 量測定上どのように影響するのかを調べた。さらに、②に ついてもこれまで検討されてこなかった新たな問題点を指 摘する。

3.3.1 酸素濃度定量値への影響

試料の厚さや不純物濃度によって多重反射の効果がどの ように現れるのかを明らかにするため、(1)式と(2) 式を用いて、多重反射考慮の有無により算出される測定値 の酸素濃度依存性、および試料厚依存性を計算した。ただ し、簡単のため、ベース吸収係数αbをゼロと仮定し、換 算係数は多重反射考慮の有無に関わらず 3.14×10¹⁷とした。

図2(a)は、厚さが JEIDA 標準試料と同じ2mmの場合 について計算した結果である。多重反射を考慮して補正し た格子間酸素濃度を[Oi]m、補正を行わない濃度を[Oi]s と する。図の縦軸右に濃度差([Oi]s-[Oi]m)を、また縦軸 左に濃度差率(([Oi]s-[Oi]m)/[Oi]s)をとり、[Oi]s に対す る依存性を示した。格子間酸素濃度が高くなるほど、多重 反射考慮の有無による濃度差が大きくなるが、濃度差率は 小さくなっていくことがわかる。たとえば、濃度が 1× 10^{18} atoms/cm³のとき、濃度差は 7×10¹⁶ atoms/cm³ ほどあ り、濃度比では7%の差があることがわかった。

次に,格子間酸素濃度を一定とした場合の試料厚依存性 を調べた。図2(b)は、多重反射を考慮しないときの酸素 濃度を 1,2,5,10×10¹⁷ atom/cm³ にそれぞれ固定し, (2)式より多重反射を考慮した透過率を求め、試料の厚 さを変えて酸素濃度を計算したものである。

試料厚が数 mm の場合,多重反射の効果は酸素濃度に





んど依らなくなる。このとき,多重反射を考慮した実測値 は、しない場合より15~16%も小さい値となることが わかる。すなわち,JEIDAで規定された2mm 厚よりもさ らに薄い試料を用いて格子間酸素濃度の定量測定を行う場 合には、多重反射の補正が不可欠である。

3.3.2 炭素濃度定量値への影響

JEIDA では、酸素の測定時には多重反射を考慮した補 正をすることになっているが、炭素では多重反射の補正を する必要はない。この理由を明らかにするために、上と同 様に置換型炭素濃度の場合についても計算した。

強く依存するが、1mm より薄い試料では酸素濃度にほと

酸素の場合,1107 cm⁻¹ あたりでのシリコン格子振動に よる吸収係数 α_L は,0.85 cm⁻¹ である¹¹⁾。シリコンの格子 振動による吸収係数は波数により異なるので,炭素の場合 には,置換型炭素の波数域 605 cm⁻¹ での吸収係数 α_L を用 いる必要がある。

図3はFZ-Si 結晶のシリコン格子振動による吸収スペクトルである。酸素を含まないので、1107 cm⁻¹ あたりの吸収 は格子振動のみの成分である。置換型炭素の吸収ピークが ある 605 cm⁻¹には、非常に強い格子振動のピークが現れて おり、この位置の吸収強度は、1107 cm⁻¹ 付近の吸収強度 の約10 倍に達する。すなわち、炭素測定の場合の 605 cm⁻¹ では、α₁ は約 8.5 cm⁻¹ であると見積もられる。

上で見積もった炭素ピーク付近の格子振動による吸収係 数 α_L を用いて,酸素の場合と同様に,厚さ 2 mm の場合 について多重反射の有無による濃度差を比較した結果が 図 4 (a) である。ただし、多重反射を考慮して補正した置 換型炭素濃度を[Cs]m、補正を行わない濃度を[Cs]s とする。 炭素の場合も同様に、濃度が高くなるに従い濃度差は大き く、濃度差率は小さくなっている。しかし、たとえば濃度 が 1×10¹⁸ atoms/cm³ で比べると、濃度差は約 1.2×10¹⁵ atoms/cm³ で、濃度比では 0.001 程に過ぎない。このよう な理由から、炭素測定においては、 α_L が大きいため多重 反射による効果が無視できるので、JEIDA の炭素濃度標



図3 Siの格子振動による吸光度スペクトル

準測定法では、多重反射を考慮しない単純な吸収係数の式 を用いた Lambert-Beer の法則が適用されている。逆にい えば、酸素測定では α_L が小さいために、多重反射の考慮 が必要となる。

酸素の場合と同様に、試料厚依存性を計算した結果が図 4 (b)である。JEIDA 規格で指定されている厚さ2mmに おいては、炭素濃度の大小に関わらず多重反射の効果はほ とんど無いが、1mm 以下の試料では多重反射の効果が強 く出てくることに注意したい。実際の多結晶シリコンの測 定で中心となる 0.2 ~ 0.5 mm くらいの厚さの試料では、 特に濃度依存性も強い。このことは、同じ厚さの試料に対 してさえ、一定の換算係数を設定することができないこと を意味する。すなわち、置換型炭素の測定においても、厚 さの薄い試料を用いる場合には、吸収ピーク強度を濃度に 変換する際、多重反射を考慮した計算を行うことが必須で あるといえる。

3.3.3 多重反射による干渉

JEIDA に規定されるよりも薄い試料を用いた場合,多 重反射によるもう一つの効果として,スペクトルに干渉縞 が現れ,高い分解能での測定ができなくなるという問題が 出てくる。

JEIDA の規定では、格子間酸素のピーク半値幅は約32cm⁻¹ であるため、分解能は4 cm⁻¹ でよい。通常、分解能4 cm⁻¹







で1107 cm⁻¹の格子間酸素ピークを干渉なしで測定するに は、厚さ2 mm はもちろんのこと、厚さ0.5 mm 程度のい わゆるシリコン単結晶基板でも問題ない。しかし、置換型 炭素の場合、605 cm⁻¹ ピークの半値幅は約6 cm⁻¹ なので、 JEIDA は2 mm 厚の試料で分解能2 cm⁻¹ での測定を推奨す る。したがって、これよりも薄い試料で置換型炭素ピーク を測定する場合には、干渉を避けるため測定分解能を落と さねばならず、注意が必要である。

3.3.4 顕微赤外法の注意点

JETDA 規定は酸素炭素とも、動作が安定した TGS 系の 検出器(400 cm⁻¹以上)を用いることになっている。顕微 赤外では、信号が弱いために高感度の MCT 検出器が用い られるが、MCT 特有の非線形性に注意すべきであり、定 量測定には向かない。MCT の有効波数範囲は通常 700cm⁻¹ 以上で、605cm⁻¹にある置換型炭素のピークは範囲外であ る。低波数対応型の MCT 検出器もあるが、非線形性は同 様に問題である。

前出の表2は、同じ測定条件下でJEIDA 標準酸素濃度 試料L, M, Hを, DTGSとMCTとで測定(顕微ではな い通常の透過測定)した結果を比較したものである。 MCTでは、表示値及びDTGSに対し酸素濃度が10%ほど 高めに出た。これは MCT 検知器の線形性が良くないので、 定量性が良くないことを表している。使用する検出器によ りそれぞれ特徴があるので注意を要する。

顕微のもう一つの問題は、カセグレン対物鏡による光路 問題である。JEIDA では平行な(に近い)垂直入射光を 前提としているが、顕微では、かなり急峻な角度で試料に 入射する。顕微赤外は、試料表面の異物等に集光して分析 することを想定しているため、本測定例のような試料内部 の定量評価の場合には注意を要する。装置メーカーによる 光路設計の差があるので一概にはいえないが、定量性に少 なからず影響しそうである。

4 まとめ

フーリエ変換赤外分光法を用いて,太陽電池用多結晶シ リコン中の格子間酸素および置換型炭素を定量測定する技 術を検討した。特に,単結晶シリコンで確立している JEIDA 標準測定法を検証し,多結晶の測定を行う際に単 結晶の場合とは異なる特有の問題を明らかにした。

軽元素不純物濃度を測定する際,「JEIDA 標準測定法に より」と断った上で,ピーク強度にそれぞれの換算係数を かけて,これを結晶中の不純物濃度としている報告を散見 する。酸素濃度については,多重反射を考慮した補正をす ること¹¹⁾,また,炭素濃度については厚さ2 mm であるこ とが JEIDA 標準法の条件である¹²⁾。

JEIDA 標準測定法によれば、格子間酸素については多

重反射の効果を考慮するが,置換型炭素の場合は無視でき る。しかしながら,多重反射の効果は不純物濃度が低いほ ど,また試料が薄いほど強く,このため多結晶測定のよう に薄い試料を用いる場合には,炭素においても酸素と同様 に,多重反射の補正が不可欠であることがわかった。この 補正を行わないと軽元素不純物濃度を過大評価してしまう。 さらに,顕微赤外法を用いる場合,MCT 検出器やカセグ レン対物鏡が定量値に影響するので,注意が必要である。

文 献

- 山鹿功雄,(独)日本学術振興会結晶加工と評価技術第 145 委員会第118回研究会資料, p.5 (2009,福岡)
- K. Arafune, T. Sasaki, F. Wakabayashi, Y. Terada, Y. Ohshita, and M. Yamaguchi; *Phisica B*, 376-377, 236 (2006).
- K. Arafune, E. Ohishi, H. Sai, Y. Terada, Y. Ohshita, and M. Yamaguchi; *Jpn. J. Appl. Phys.*, 45, 6153 (2006).
- N. Usami, K. Kutsukake, K. Fujiwara, I. Yonenaga, and K. Nakajima; *Appl. Phys. Express*, 1, 075001 (2008).
- 5) 小島拓人,福田晃司,大下祥雄,山口真史,(独)日本 学術振興会第175委員会第6回「次世代の太陽光発電 システム」シンポジウム予稿集, p.49,(2009,新潟)

- J. Lu, G Rozgonyi, J. Rand, and R. Jonczyk; *Appl. Phys. Lett.*, 85, 1178 (2004).
- J. Lu, G. Rozgonyi, A. Schonecker, A. Gutjahr, and Z. Liu; J. Appl. Phys., 97, 033509 (2005).
- P. Kulshreshtha, M. Wagener, M. Reed, O. Sulima, R. Jonczyk, and G. Rozgonyi; 17th Workshop on Crystalline Silicon Solar Cells & Modules: Materials and Processes, (NREL Workshop, 2007, Vail, Colorado USA) p.209.
- J. Lu, M. Wagener, G. Rozgonyi, J. Rand, and R. Jonczyk; J. Appl. Phys., 94, 140 (2003).
- J. Lu, G. Rozgonyi, J. Rand, and R. Jonczyk; J. Cryst. Growth, 269, 599 (2004).
- JEIDA 規格「赤外吸収によるシリコン中の格子間酸 素原子濃度の標準測定法」00-基-15, JEIDA-61-2000, 2000 年8月発行,(社)日本電子工業振興協 会
- JEIDA 規格「赤外吸収によるシリコン結晶中の置換型炭素原子濃度の標準測定法」98-基-19, JEIDA-56-1998, 1998年3月発行,(社)日本電子工業振興協会

Determination of the Oxygen and Carbon Concentration in Polycrystalline Silicon by Infrared Absorption Spectroscopy

Haruhiko ONO, Takahide ISHIZUKA, and Atsushi OGURA

We studied the quantitative determination method of interstitial oxygen and substitutional carbon concentration in polycrystalline silicon for solar cells. The standard method by JEIDA was carefully examined, so that the problems for polycrystalline instead of single crystal are clarified. Multiple reflections affect the concentration measured for samples that have less impurity concentration and with thickness thinner than the JEIDA proposal. Therefore, the correction due to multiple reflections should be considered even if for carbon as well as oxygen, when the thin samples are used for the measurements.